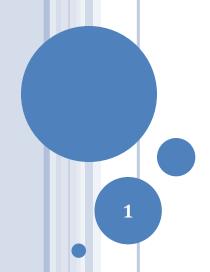
компоненты свч



ОСОБЕННОСТИ ВОЛН СВЧ ДИАПАЗОНА

- Размеры аппаратуры соизмеримы с длиной волны на сверхвысоких частотах
- Волны СВЧ диапазона обладают квазиоптическими свойствами
- Волны СВЧ диапазона беспрепятственно проникают через ионизированные слои, окружающие Землю, и слои атмосферы

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ

Классификация частотных диапазонов в соответствии с российским стандартом

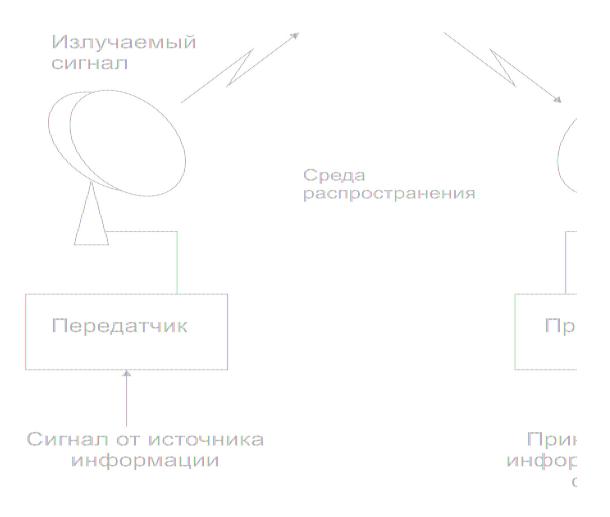
Частота (ГГц)	Название
0,3—3	Ультравысокие частоты(УВЧ) (дециметровые)
3—30	Сверхвысокие частоты(СВЧ) (сантиметровые)
30—300	Крайневысокие частоты(КВЧ) (милиметровые)

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТОТНЫХ ДИАПАЗОНОВ

Зарубежная классификация

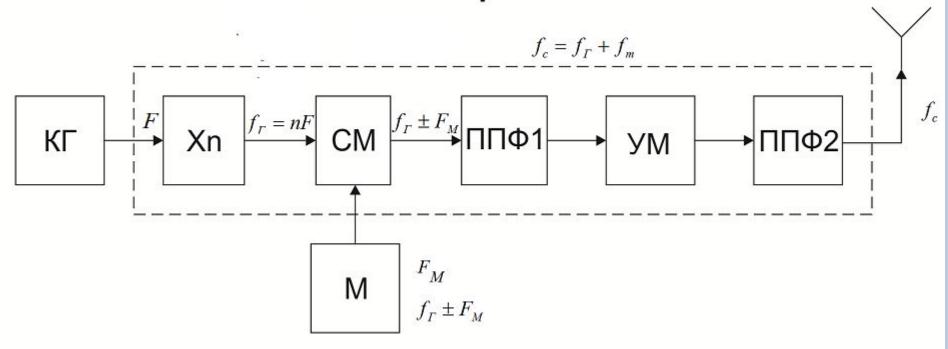
Частота (ГГц)	Название	
0,4—2,7	L	
0,4—2,7 2,7—4	S	
4—8	С	
8—12	X	
12—18	Ku	
18—26	K	
26—40	Ka	
>40	mm wave	

СИСТЕМА СВЯЗИ

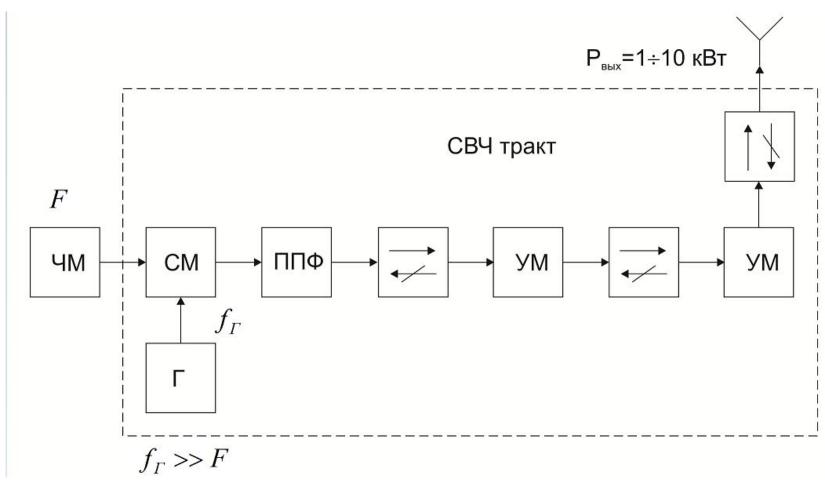


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

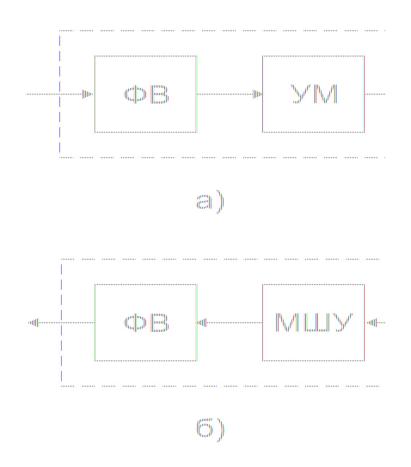
СВЧ тракт



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ (ССС)



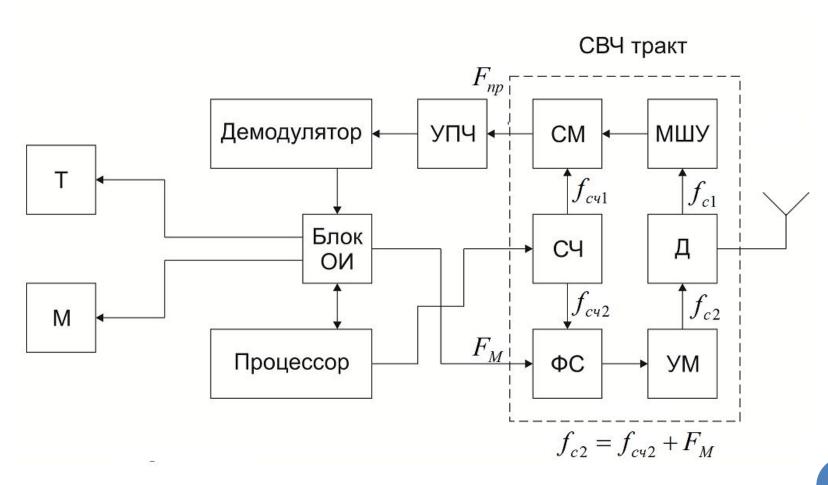
ПРИЕМНЫЙ И ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛИ АФАР



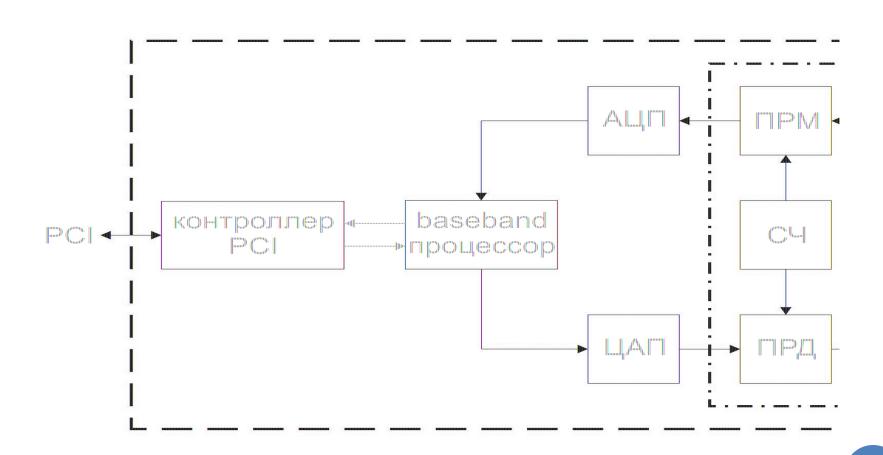
а) передающий модуль

б) приёмный модуль

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЕРЕДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ



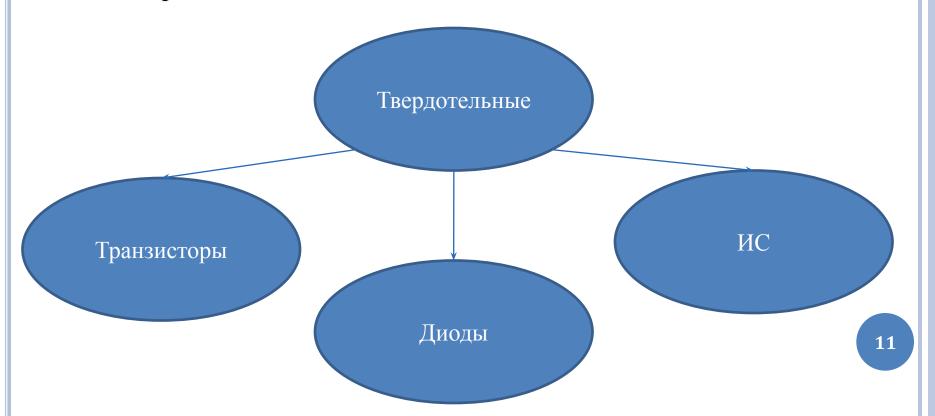
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АДАПТЕРА WI-FI



КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СВЧ

По типу активной среды:

- вакуумные
- твердотельные



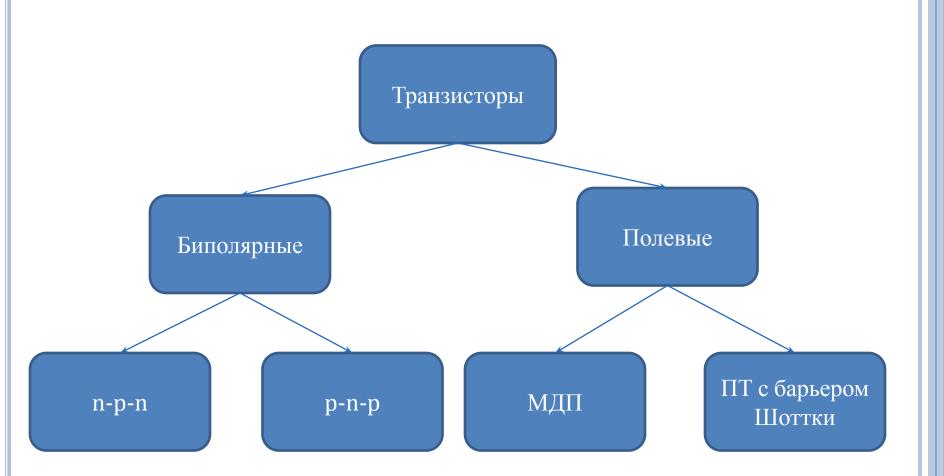
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНЗИСТОРОВ

Транзистор – прибор, который служит для преобразования, усиления и генерирования сигналов

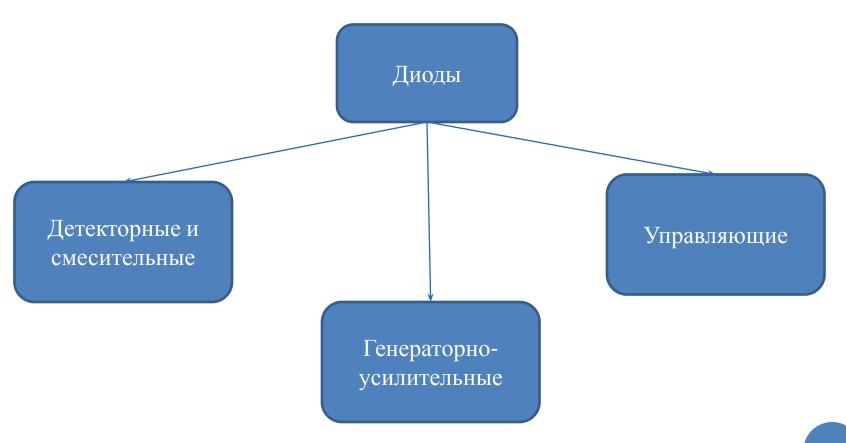
Классификация транзисторов по мощности:

- Большой мощности (10 Вт)
- Средней мощности (~1 Вт)
- Малой мощности (< 1 Вт)

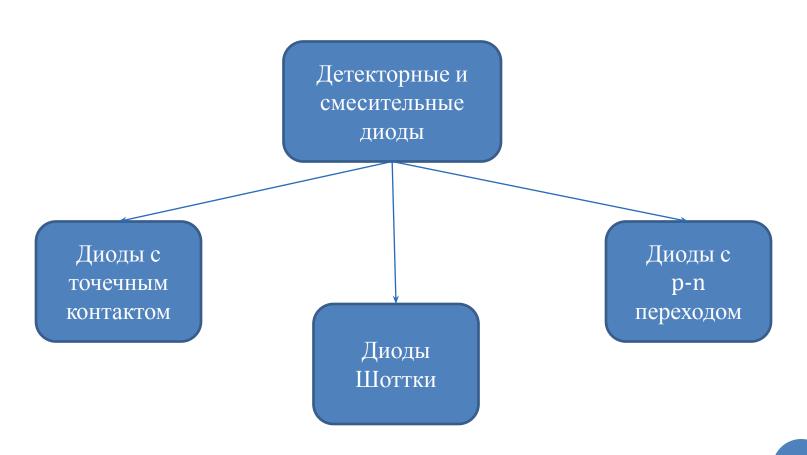
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНЗИСТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ



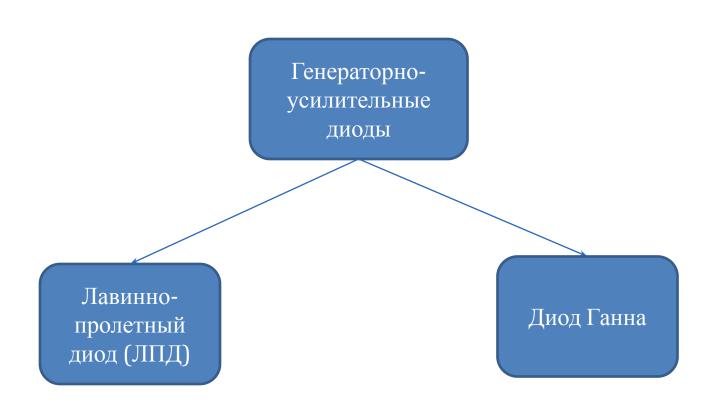
Классификация диодов по функциональному назначению



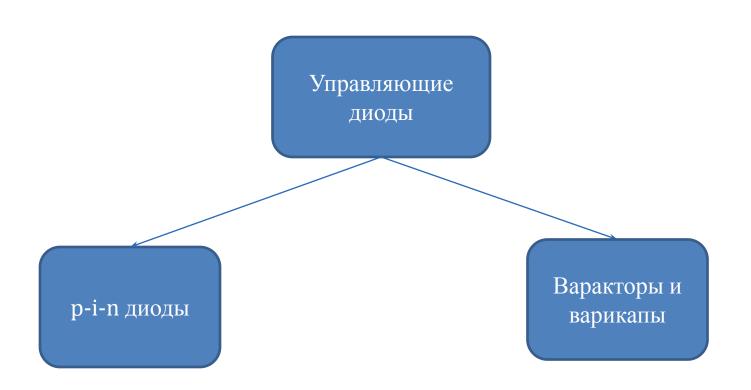
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТЕКТОРНЫХ И СМЕСИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ



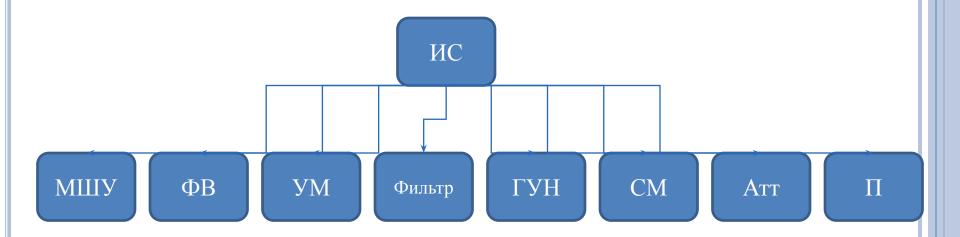
Классификация ГЕНЕРАТОРНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ



Классификация управляющих диодов



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ



МШУ – малошумящий усилитель

ФВ – фазовращатель

УМ – усилитель мощности

Гун – генератор, управляемый напряжением

СМ – смеситель

Атт – аттенюатор

 Π — переключатель

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИС ДЛЯ X- И K-ДИАПАЗОНОВ

ТИП ИС	Параметры	Х-диапазон	К-диапазон
УМ	Вых. мощность	7—12 Вт	2—4 Вт
	К-т усиления	6—8 дБ	5—7 дБ
	КПД	35—45%	25—35%
МШУ	К-т усиления	8—9 дБ	7—8 дБ
	К-т шума	0,8—1,5 дБ	2—2,5 дБ
ФВ	Ошибка фазы	2—4°	2—4°
	Потери	3—7 дБ	3—7 дБ
Атт	Диапазон регулировки	32—64 дБ	32—64 дБ

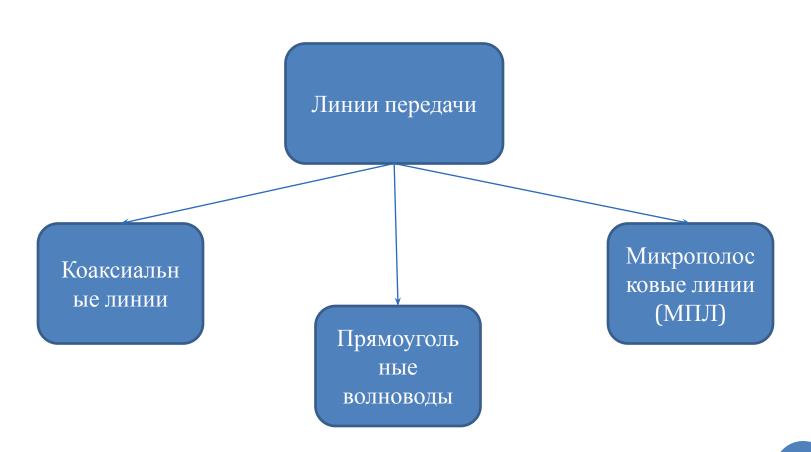
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

Электровакуумные приборы:

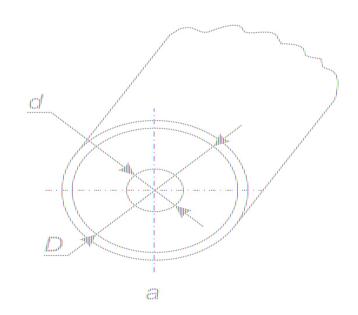
- По характеру энергообмена
 - Типа О (преобразование кинетической энергии электронов в энергию СВЧ поля)
 - Типа M (преобразование потенциальной энергии электронов в энергию СВЧ поля)
- По продолжительности взаимодействия электронов с СВЧ полем
 - Кратковременное (клистроны)
 - Длительное (лампы бегущей волны (ЛБВ) и лампы обратной волны (ЛОВ))

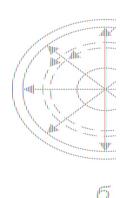


ТИПЫ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ



КОАКСИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ





Основной тип волны - ТЕМ

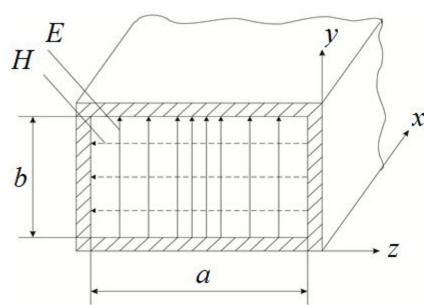
Волновое сопротивление:

$$\rho_{\scriptscriptstyle B} = 60 \ln \left(\frac{D}{d}\right) / \varepsilon^{1/2}$$

Длина волны:

$$\lambda_{JI} = \lambda_0 / \varepsilon^{1/2}$$

прямоугольный волновод



Структура поля для волны основного типа Н

Длина волны:
$$\lambda_{JI} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{\kappa p}}\right)^2}}$$

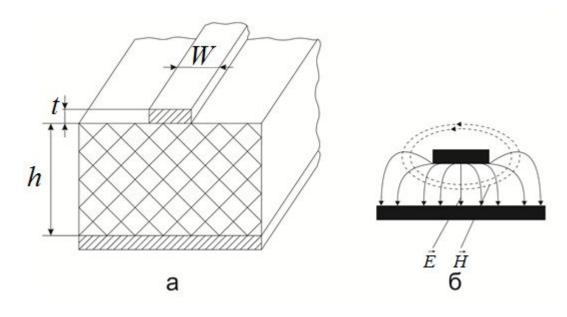
Волновое сопротивление:
$$\rho_B = \frac{120\pi b}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{\kappa p}}\right)^2}$$

Критическая длина волны: $\lambda_{\kappa p} = 2a$

$$\lambda_{\kappa n} = 2a$$

Волна не распространяется по волноводу, если ее длина больше критической

НЕСИММЕТРИЧНАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ



основной тип волны – квази ТЕМ

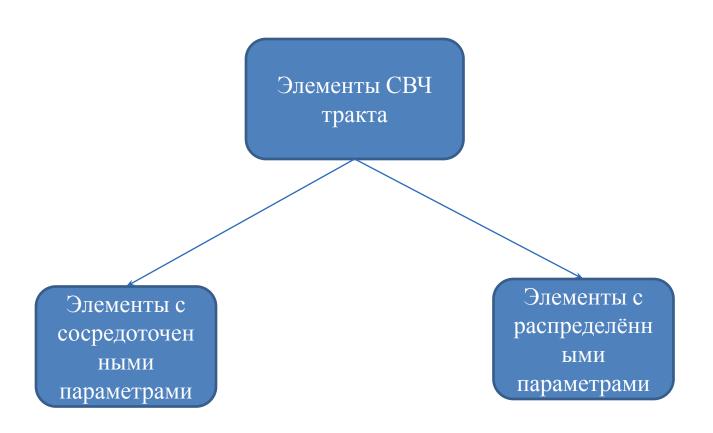
Длина волны: $\lambda_{JI} = \lambda_0 / \varepsilon_{9\phi\phi}^{1/2}$

$$\varepsilon_{9\phi\phi} = \frac{\varepsilon + 1}{2} + \frac{\varepsilon - 1}{2\sqrt{1 + 10\frac{h}{W}}}$$

С ростом частоты изменяется $\varepsilon_{9\varphi\varphi}$. Такое явление называют *дисперсией*.

• ЭЛЕМЕНТЫ СВЧ ТРАКТА

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЭЛЕМЕНТЕ



ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Элементы с сосредоточенными параметрами:

- характерно наличие пространственного разделения электрического и магнитного полей
- Размеры элементов много меньше длины волны $l_{_{9}} << \lambda$

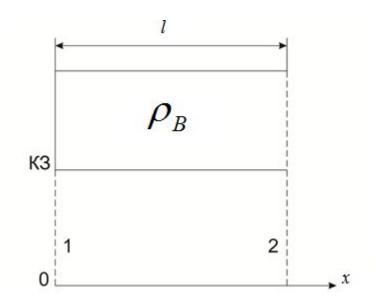
Элементы с распределёнными параметрами:

- характерно отсутствие пространственного разделения электрического и магнитного полей, то есть в любой точке может присутствовать электрическое и магнитное поле
- Размеры элементов соизмеримы с длиной волны $l_{_{9}} \ge \lambda$

ПАРАМЕТРАМИ (РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ)

Режим К.З.:

$$\mathbb{E}_{ex.k3.} = j\rho_B tg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$



ЭЛЕМЕНТЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ)

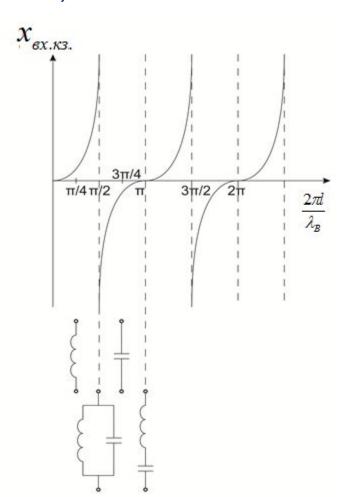
Режим К.З.:

$$x_{ex.k3.} = \rho_B tg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$

Расчет индуктивности

$$\omega L = \rho_B tg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$

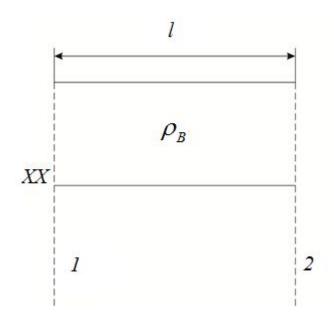
$$L = \frac{\rho_B tg \frac{2\pi l}{\lambda_B}}{\omega}$$



ПАРАМЕТРАМИ (РЕЖИМ ХОЛОСТОГО ХОДА)

Режим Х.Х.:

$$\mathbb{E}_{ex.x.x.} = -j\rho_B ctg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$



ПАРАМЕТРАМИ (РЕЖИМ ХОЛОСТОГО ХОДА)

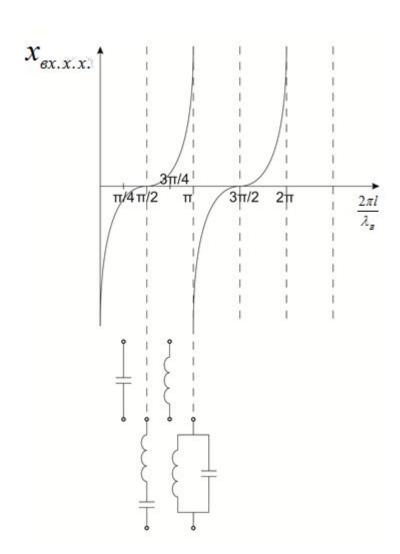
Режим Х.Х.:

$$x_{ex.X.X.} = -\rho_B ctg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$

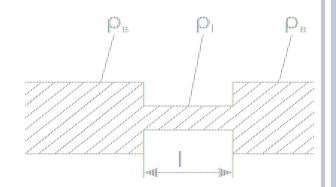
Расчет емкости:

$$\frac{1}{\omega C} = \rho_B ctg \frac{2\pi l}{\lambda_B}$$

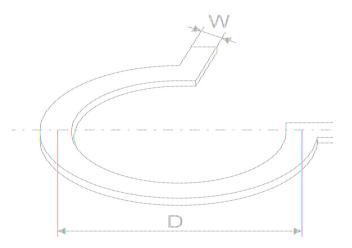
$$C = \frac{1}{\omega \rho_B ctg \frac{2\pi l}{\lambda_B}}$$



1. Высокоомный отрезок линии:

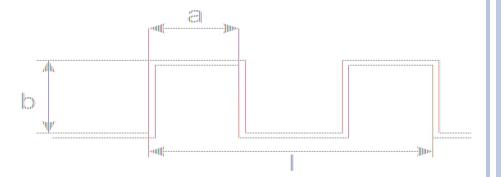


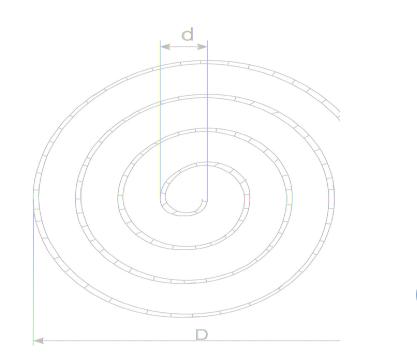
2. Одновитковая катушка:



3. Меандр:

4. Спираль:





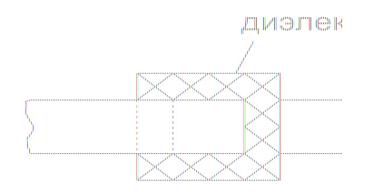
5. Пластинчатая ёмкость:

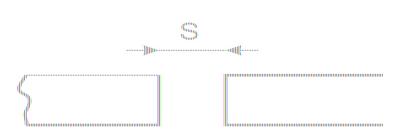
$$C \approx \frac{\varepsilon_0 \varepsilon \cdot S}{d}$$

где S – площадь перекрытия пластин, d – толщина диэлектрика.



$$C \leq 4n\Phi$$





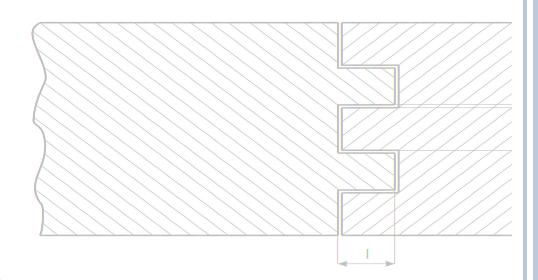
7. Гребенчатая емкость:

$$C = (\varepsilon + 1)\varepsilon_0 \cdot l[2A_1(N-1) + A_2]$$

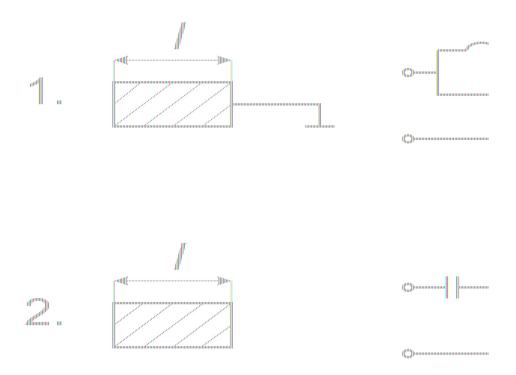
$$A_1 = 0.614 \left(\frac{h}{s}\right)^{0.25} \left(\frac{t}{h}\right)^{0.439}$$

$$A_2 = \frac{0.775t}{(2N-1)(t+s)} + 0.408$$

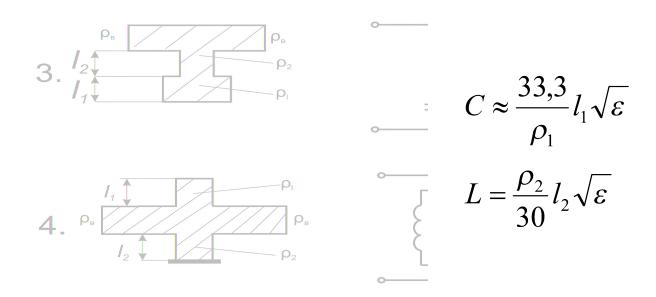
где N – число секций, h – толщина подложки, C – в пФ/ед. длины.



МИКРОПОЛОСКОВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ



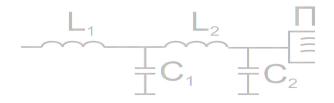
МИКРОПОЛОСКОВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ



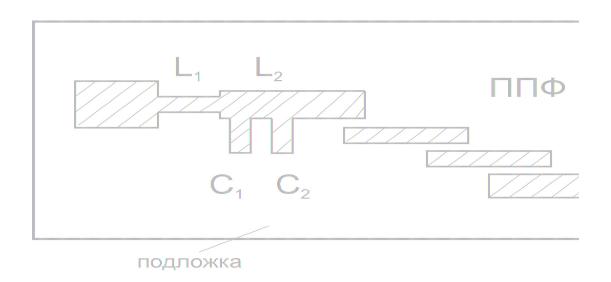
 $C - B п \Phi$, $L - B н \Gamma H$, I - B C M, $\rho - B O M$

CB4 CXEMA

Принципиальная схема:



Топология схемы



ТРАНЗИСТОРЫ СВЧ● ДИАПАЗОНА

40

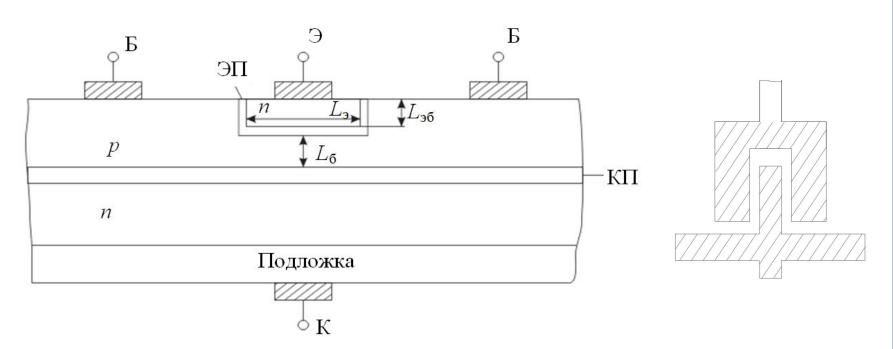
ТЕ ЖЕ ПРИНЦИПЫ, ЧТО И В РАБОТЕ НЧ ТРАНЗИСТОРОВ

ОСОБЕННОСТИ СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ

- 1. Ограничение рабочей частоты транзистора временем переноса носителей через транзистор
- 2. Ограничение рабочей частоты транзистора, обусловленное скоростью изменения заряда, накопленного в транзисторе
- 3. Влияние на рабочую частоту транзистора конструкции выводов транзистора и их паразитных параметров

СТРУКТУРА БИПОЛЯРНОГО

БИПОЛЯРНЫМ АНЗВІВАЮРРАНЗИСТОР, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЗАРЯДЫ НОСИТЕЛЕЙ ОБЕИХ ПОЛЯРНОСТЕЙ



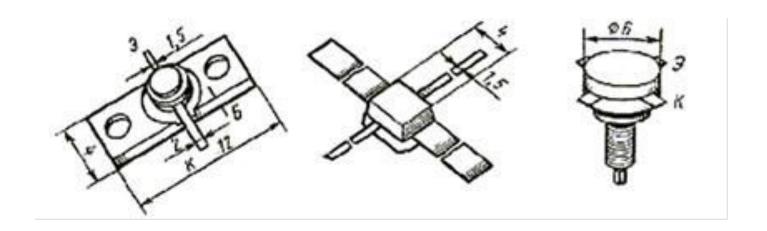
СВЧ биполярные транзисторы отличаются от низкочастотных прежде всего размерами активных областей, которые характеризуются шириной эмиттерной полоски $l_{_{9}}$ и толщиной базы $l_{_{6}}$.

Современная технология позволяет получить эмиттерные полоски шириной $l_{_{9}}$ меньше 0,1 мкм и толщину базы $l_{_{\overline{0}}}$ несколько десятков нанометров.

Наличие сверхтонкой базы является одной из особенностей транзисторов СВЧ.

Для более мощных СВЧ-транзисторов используется объединение в одном кристалле большого числа единичных структур (до 150).

Особенности СВЧ-транзисторов с точки зрения конструкции выводов эмиттера, коллектора и базы состоят в том, что выводы делают в виде коротких полосок, удобных для сочленения с микрополосковыми линиями передачи. Такая геометрия выводов наиболее полно отвечает требованиям уменьшения их «паразитных» емкостей и индуктивностей.



РАСЧЕТ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

$$f_{zp} = \frac{1}{2\pi\tau_{_{2K}}}$$

$$\tau_{_{9\mathcal{K}}} = \tau_{_{9}} + \tau_{_{\mathcal{K}}} + \tau_{_{\mathcal{G}}} + \tau_{_{9\mathcal{G}}} + \tau_{_{\mathcal{G}\mathcal{K}}}$$

т, - время накопления неосновных носителей в эмиттере,

 $\tau_{_{\rm K}}$ – время задержки носителей в обедненной области коллектора,

 $\tau_{_{0}}$ – время пролета неосновных носителей через базу,

 $\tau_{_{96}}$ – время заряда емкости эмиттерного перехода,

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ В ЭМИТТЕРЕ

$$\tau_{\scriptscriptstyle 9} = \frac{l_{\scriptscriptstyle 96}^{2}}{2D_{\scriptscriptstyle p9}\beta_0}$$

где l_{96} - расстояние от поверхности транзистора до металлургической границы эмиттерного перехода, D_{p9} - коэффициент диффузии дырок в эмиттере, β_0 - коэффициент усиления по постоянному току

ВРЕМЯ ПЕРЕНОСА НОСИТЕЛЕЙ В ОБЕДНЕННОЙ ОБЛАСТИ КОЛЛЕКТОРА

$$\tau_{\kappa} = \frac{l_{\kappa}}{2v_{\kappa}}$$

где l_{κ} – ширина обедненной области коллектора v_{ε} - скорость насыщения носителей

ВРЕМЯ ПРОЛЕТА НЕОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ БАЗУ

$$\tau_{\delta} = \frac{l_{\delta}^{2}}{nD_{n\delta}}$$

где l_{δ} – толщина базы,

n – коэффициент, зависящий от распределения примесей в базе,

D_{пб} - коэффициент диффузии электронов в базе

ВРЕМЯ ЗАРЯДА ЕМКОСТИ ЭМИТТЕРНОГО ПЕРЕХОДА

$$\tau_{96} = R_{\beta}C_{9}$$

где R_{β} – сопротивление рекомбинации

$$R_{\beta} = \frac{\varphi_{T}}{I_{\mathfrak{I}}} \qquad \varphi_{T} = \frac{kT}{e}$$

ВРЕМЯ ЗАРЯДА ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА

$$\tau_{\delta\kappa} = C_{\kappa}(r_{\vartheta} + r_{\kappa})$$

где $r_{_{9}}$, $r_{_{K}}$ – сопротивления эмиттерной и коллекторной областей;

С - емкость коллектора

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ТРАНЗИСТОРА

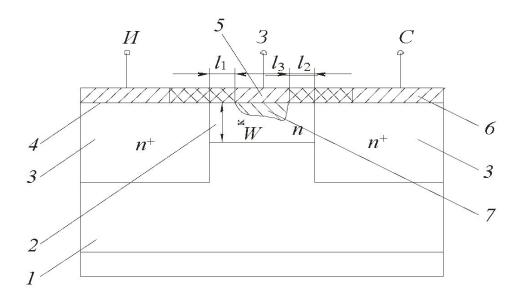
- 1. Уменьшение l_{κ} ;
- 2. Уменьшение l_6 ;
- 3. Уменьшение C_{3} и C_{K} ;
- 4. Уменьшение г

Примеры противоречивых требований

Требования 1 и 3 связаны с увеличением граничной частоты. Однако уменьшение $l_{_{\rm K}}$ приводит к росту ${\rm C}_{_{\rm K}}$

Требование 3, связанное с уменьшением C_э, находится в противоречии с требованием увеличения мощности транзистора, согласно которому площадь эмиттера требуется увеличивать.

СТРУКТУРА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА



- 1 высокоомная подложка, выполненной из GaAs,
- 2 -проводящий канал n-типа подсоединен к выводам истока $\mathcal U$ и стока $\mathcal C$.
- 3- невыпрямляющие контакты, образованные n^+ областями и контактами 4 и 6,
- 4 и 6 металлические электроды
- 5 затвор, у которого на границе с *n*-каналом образован барьер Шоттки.
- 7 обедненная область

При подаче напряжения между стоком и истоком через *п*-канал протекает электронный ток.. Затвор 5 используется в ПТ для управления током транзистора с помощью внешнего сигнала. При протекании тока через канал возникает падение напряжения на распределенном сопротивлении канала вдоль его длины. Область обедненного слоя может расширяться до высокоомной подложки 1 и перекрывать проводящий канал. При этом ток транзистора в цепи исток - сток практически перестает зависеть от напряжения стока.

РАСЧЕТ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

$$f_{zp} = \frac{1}{2\pi\tau_{np}}$$

где $\tau_{\rm np}$ – это время пролета носителей через канал

$$\tau_{\it np} = \frac{L}{\nu_{\it hac}}$$
 где L – длина канала: L = l_1 + l_2 + l_3 L = 1,2 l_3

Для получения высокочастотных приборов необходимо:

- обеспечить малую длину канала
- большую дрейфовую скорость насыщения.

Из этих условий вытекает ряд требований к материалу транзистора и к размерам его электродов. В качестве материала канала в ПТ используют преимущественно арсенид галлия GaAs. Это объясняется тем, что подвижность электронов в этом материале в несколько раз выше, чем в кремнии, поэтому различаются и скорости насыщения, которые составляют $2 \cdot 10^7$ см/с для GaAs и $0.8 \cdot 10^7$ см/с для Si. Имеются данные о создании ПТ на основе фосфида индия InP, в котором дрейфовая скорость носителей в 1,5 раза выше, чем в арсениде галлия.

Однако, сокращая L, нужно одновременно уменьшать и глубину канала $w_{_{\kappa}}$ так, чтобы выполнялось условие $L/w_{_{\kappa}} > 1$, в противном случае затвор транзистора не сможет эффективно контролировать движение электронов в канале. Для уменьшения $w_{_{\kappa}}$ используют более высокий уровень легирования канала, не превышающий, однако, $5\cdot 10^{17}$ см⁻³ (во избежание пробоя). При таком уровне легирования минимальная длина затвора ограничена значением около 0,1 мкм, что соответствует граничной частоте f_{zp} =100 ГГ ψ .

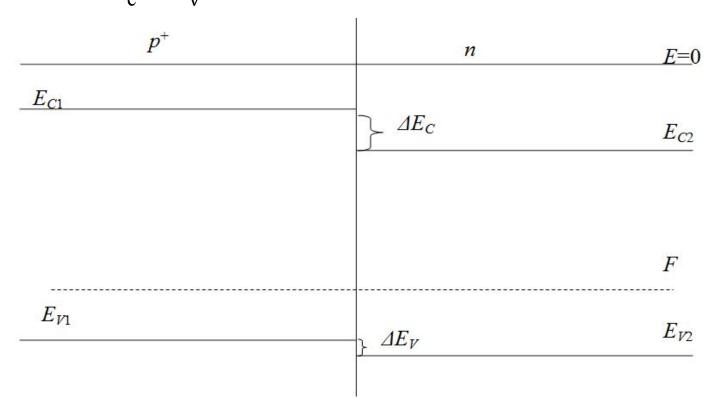
• ГЕТЕРОПЕРЕХОДЫ

ПОНЯТИЕ О ГЕТЕРОПЕРЕХОДЕ

□ Гетеропереход образуется при контакте двух полупроводниковых кристаллов, имеющих разную ширину запрещенной зоны, одинаковую кристаллическую структуру и равные постоянные кристаллической решетки.

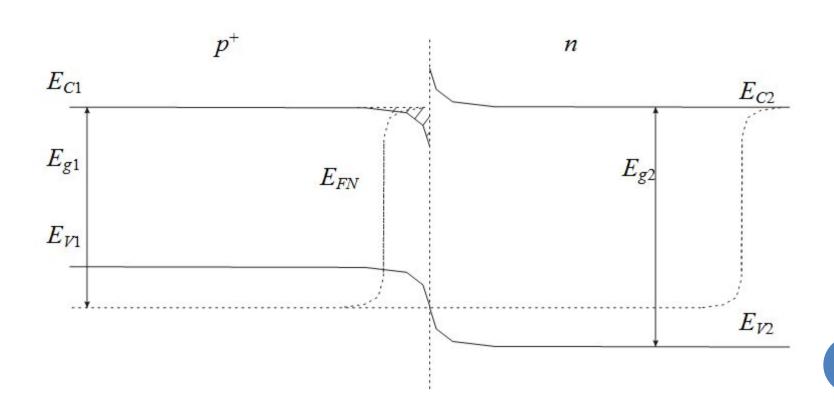
ЗОННАЯ ДИАГРАММА ГЕТЕРОПЕРЕХОДА

Особенности данной диаграммы состоят в наличии скачков ΔE_{c} , ΔE_{v}



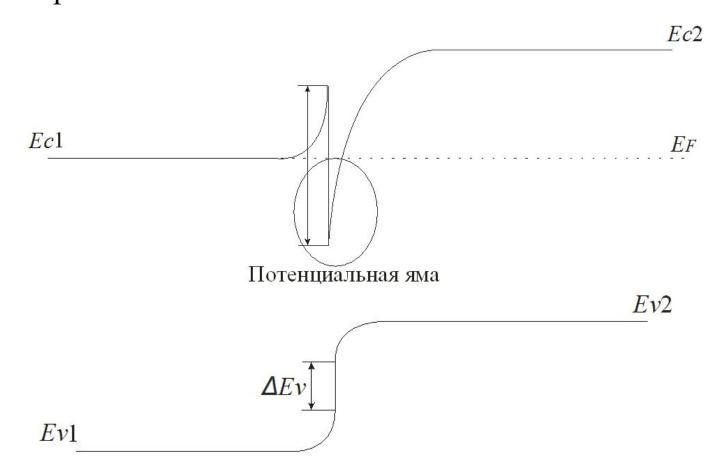
ЯВЛЕНИЕ СВЕРХИНЖЕКЦИИ

Скачки дна зоны проводимости способствуют тому, что электронный квазиуровень (E_Fn , E_Fp) располагается выше уровня E_C1

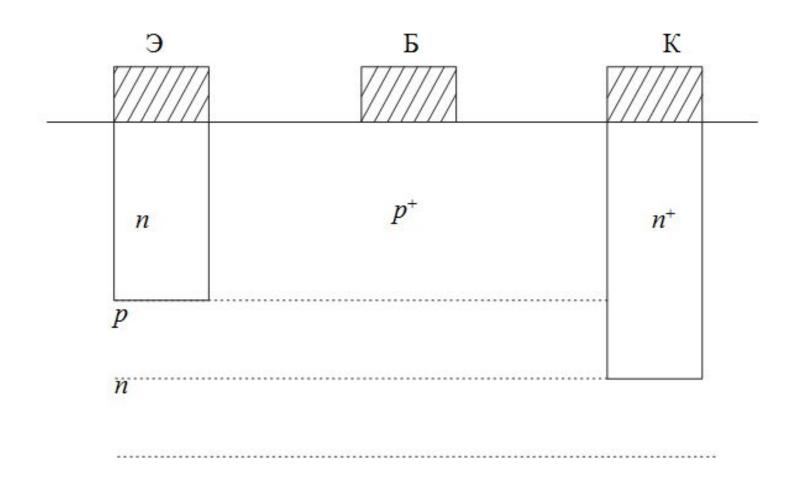


ДВУМЕРНЫИ ЭЛЕКТРОННЫИ ГАЗ

Образуется потенциальная яма, куда «сваливаются» электроны



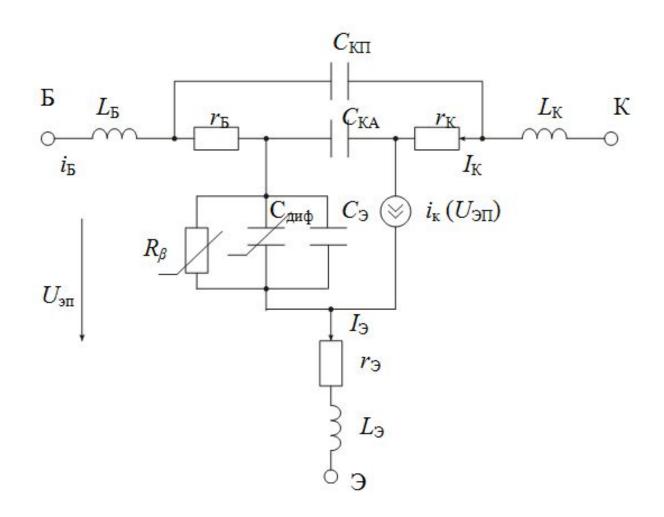
СТРУКТУРА БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА НА ГЕТЕРОПЕРЕХОДЕ (HBT)



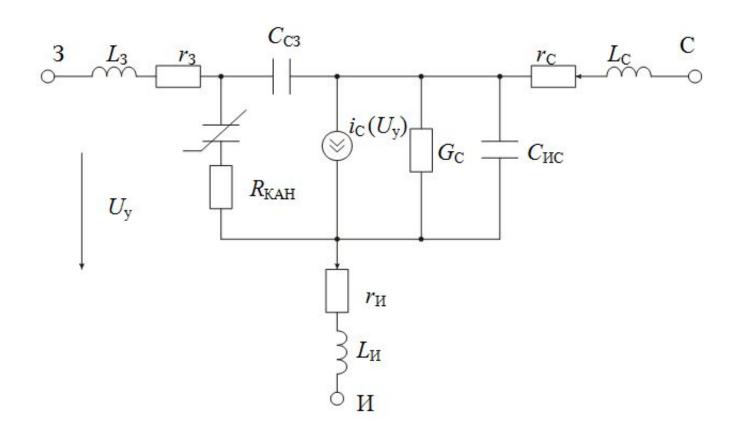
СТРУКТУРА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА НА ГЕТЕРОПЕРЕХОДЕ (HEMT)

И	3	C
	n+ - AlGaAs	Широкозонный полупроводник
	AlGaAs	Спейсер 5нм
		2D-газ
	GaAs	Узкозонный полупроводник

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА СВЧ ДИАПАЗОНА

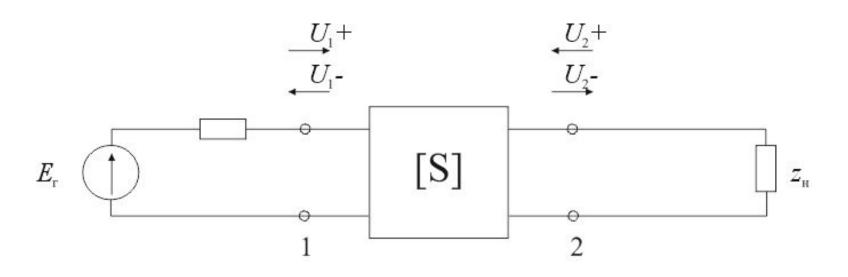


ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА СВЧ ДИАПАЗОНА



К ОПРЕДЕЛЕНИЮ S-ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРОВ

СХЕМА ЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ



$$U_{1}^{-} = S_{11} U_{1}^{+} + S_{12} U_{2}^{+},$$

$$U_{2}^{-} = S_{21} U_{1}^{+} + S_{22} U_{2}^{+},$$

S – ПАРАМЕТРЫ

$$S_{11} = U_{1}^{-} / U_{1}^{+}, U_{2}^{+} = 0;$$
 $S_{22} = U_{2}^{-} / U_{2}^{+}, U_{1}^{+} = 0;$
 $S_{12} = U_{1}^{-} / U_{2}^{+}, U_{1}^{+} = 0;$
 $S_{21} = U_{2}^{-} / U_{1}^{+}, U_{2}^{+} = 0$